【発明の名称】移動するストリップの層厚を測定する装置及び方法

【要約】
本発明は、移動ストリップの層厚を測定する方法ともとるものである。測定装置はトランスミッタ本体を含み、トランスミッタ本体は、トランスミッタ・ハウジング3内を軸方向に可動であり、ガス・クッション2を介してストリップ層に載せられる。ハウジング3から突出したセンサヘッドとトランスミッタ・ハウジング3内に近接されたチャンバ7内に沿った上部6とを有している。トランスミッタ・ハウジング3は、ガス供給用の少なくとも1つのポート9を備え、このガスの一部は前記ガス・クッションを形成し、また一部はチャンバ7内へ流入する。この測定装置の特徴は、トランスミッタ・ハウジング3がチャンバ7からガスを排出するためのリストリク7とを備えていることである。また、この測定方法は、測定装置によりストリップ層2を測定する段階を含み、該リストリク7は、ストリップ層2に対するガス・クッションの圧力が0～65g/cm²程度等のなるように調節される。